13 лекция. Температура плавления нанокластеров. Методика определения фактора Дебая-Валлера по интенсивности спектров СРЭО. Учет влияния подложки на температуру плавления нанокластеров золота, сформированных на их поверхности.



#### National Research Nuclear University "MEPhl" 31 Kashirskoe chausse, 115409 Moscow, Russia



#### Почему нанокластеры на подложке?

Свободные нанокластеры просты для симуляций





#### Плавление нанокластеров



## Исследуемые системы Осажденные нанокластеры Au, *d* = 2 - 8 nm



Au / аморфная пленка SiO<sub>2</sub> / Si, ПЭМВР JEM 2000 EX (MEPhI)



### Условия эксперимента

#### ИЛО золота в СВВ XSAM-800 system



Лазер YAG:Nd 1.06 мкм laser, режим модулируемой добротности, длительность импульса ~15 нс, 10<sup>8</sup> Вт/см<sup>2,</sup> давление 10<sup>-9</sup> Торр



in situ РФЭС, СРЭО, ex situ СТМ, ПЭМ Спектроскопия рассеянных электронов на отражение



@ Комнатная температура

# Экспериментальные СРЭО спектры нанокластеров Аи на ВОПГ









#### Шероховатость поверхности

атоме Структурный фактор среднеквадратичное отклонение локальной высоты от  $\sqrt{\langle \xi^2 \rangle}$ среднего значения Температура Дебая и Температура плавления

Амплитуда упругого рассеяния электрона на одном атоме Фактор Дебая Валлера 🖒

$$\sqrt{\langle u^2 \rangle}$$

$$V \sim \langle u^2 \rangle \sim 1/\Theta_p^2 \sim 1/T$$

$$\frac{1}{1}$$

упругого рассеяния:  $I \sim \frac{d\sigma}{d\Omega}(\varphi_0) = \left| f(\varphi_0) \right|^2 \cdot S \cdot \exp(-2W)$ 

Зависимость интенсивности упруго рассеянных электронов от дифференциального сечения упругого рассеяния:

## Зависимоть интенсивности І от размера осажденных нанкластеров



#### Шероховатость поверхности кластеров Аи на ВОПГ



среднеквадратичное отклонение локальной высоты от среднего значения







Аи/ВОПГ, 8×8 нм<sup>2</sup> СТМ

# Размерная зависимость температуры плавления нанокластеров Au на



Существенная зависимость T<sub>m</sub>(d) от типа подложки



#### Фазовое состояние нанокластеров Au



Аи/ВОПГ, 8×8 нм<sup>2</sup> СТМ

Au/SiO<sub>2</sub>, 12×12 нм<sup>2</sup> ПЭМ

#### Термодинамический подход

